

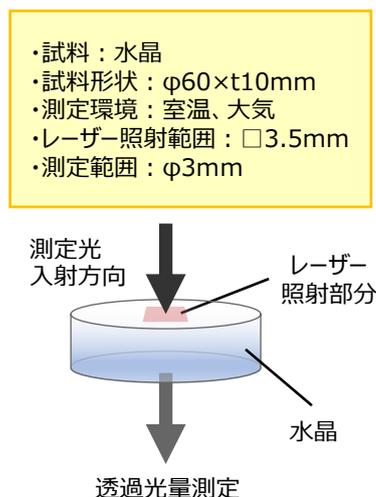
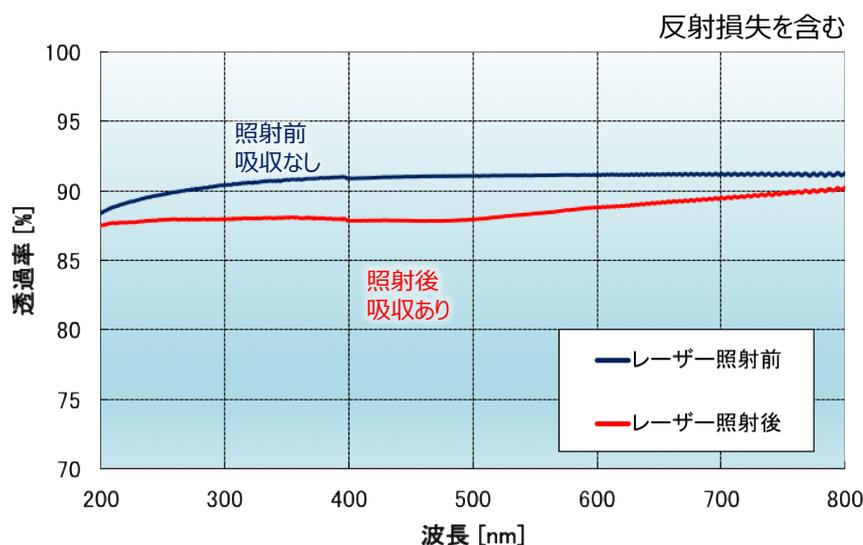
指定領域の透過率測定

ArFエキシマレーザー照射の透過率測定

概要

試料のArFエキシマレーザー照射ダメージを調査するため、透過率変化による評価を行いました。レーザー照射前後のφ3mmの指定範囲について、ダブルビーム光学系方式の分光光度計による波長スキャン測定を行いました。レーザー照射後の透過率チャートにはカラーセンターと呼ばれる吸収帯が確認され、レーザー照射領域の構造変化を捉えることができました。

結果・データ



測定の特徴

- 透過率測定器はダブルビーム光学系方式の分光光度計を使用
 - ・高精度かつ高速スキャンが可能
 - ・指定エリアの測定に対応
- ArFエキシマレーザー設備による各種条件での照射が可能

【波長範囲】 120～25000nm

※ダブルビームでの測定は～3300nm

【試料】 透過性のあるガラス、結晶、樹脂、液体

応用例

◎ 加速試験としてのレーザー照射のみにも対応

◎ 透明液体のVUV領域の透過率測定

光ガラス株式会社

住所：012-0104 秋田県湯沢市駒形町字三又白幡155
 TEL：0183-42-4299 FAX:03-6433-3756
 E-mail：Hikari.Sales_info@nikon.com
 URL：https://www.hikari-g.co.jp/

光ガラスの受託計測

基本的な光学特性評価はもちろん、最先端の装置による真空紫外領域の物性評価、複屈折測定など様々なご要望にお応えします。
 また、精密用途部品や高精度測定のための加工についてもご相談を承ります。